## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-289268

(43) Date of publication of application: 04.11.1997

(51)Int.Cl.

H01L 23/28

G06T 1/00

(21)Application number: **09-008968** 

(71)Applicant: HARRIS CORP

(22)Date of filing:

21.01.1997

(72)Inventor: MATTHEW M SALATINO

S JAMES STUDEBAKER

(30)Priority

Priority number : 96 592472

Priority date : 26.01.1996

Priority country: US

96 671430

27.06.1996

US

# (54) INTEGRATED CIRCUIT DEVICE HAVING OPENING TO EXPOSE DIE OF INTEGRATED CIRCUIT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

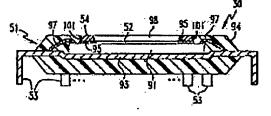
(57) Abstract:

circuit.

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit the direct contact with a die of an integrated circuit through a detected medium like a user's finger, by forming a frame member mounted on a main body of a capsulizing material, which surrounds the die of the integrated circuit and locates near an inner opening.

SOLUTION: For example, at packaging finger print sensor, a package 51 forms the main body 94 of a capsulizing material for the package. For this, a die 91 of an integrated circuit mounted on a lead frame is involved during injection molding. Connections are formed with bonding wires 97 to outwards extending lead wires 53 and lead frame 93. The upper surface of the package 51 has an integrated opening 98 permitting the contact with the die 91, i.e., the finger and a sensor 30 to contact with the die 91. Thus, the direct contact

with the die 91 is permitted with a high-reliability environmental seal of the die 91 of the integrated



## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出顧公開番号

## 特開平9-289268

(43)公開日 平成9年(1997)11月4日

(51) Int.CL <sup>4</sup>		微別記号	庁内整理書号	ΡI			技術表示箇所
H01L	23/28		,	HOIL	23/28	Z	
G06T	1/00			G08F	15/64	G	

#### 審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 11 頁)

(21)出頭番号	特罰平8~8968	(71)出竄人	594071675
(22)出顧日	平成9年(1997)1月21日		ハリス コーポレイション Harris Corporation アメリカ合衆国 フロリダ 32919 メル
(31)優先権主張番号	592472		パーン、ナサ プルパード 1025
(32)優先日	1996年1月26日	(72)発明者	マシュー エム サラティノ
(33)優先推主張國	米国 (US)		アメリカ合衆国, フロリダ 32937, サテ
(31)優先権主張番号	671430		ライト・ピーチ、ジャクソン・コート
(32)優先日	1996年8月27日		615書
(33)優先權主張国	米図 (US)	(72)発明者	エス ジェームズ スチュードベイカー
			アメリカ合衆国, フロリダ 32905, パー
			ムペイ、チャンピオンズ・ドライヴ・エヌ
			イー 854番
		(74)代理人	<b>弁理士 伊東 忠彦 (外1名)</b>

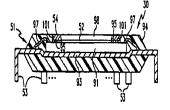
-1-

#### (54) 【発明の名称】 集積回路のダイを露出させる関ロ部を有する集積回路装置とその製造方法

### (57)【要約】

【課題】 本発明は、集積回路のダイに対する個類性の 高い環境の對止を行うため、ダイの直接的な接触が可能 な集積回路装置の提供を目的とする。

【解決手段】 本発明による集積回路設置は、集積回路 のダイと、ダイを取り囲み、ダイの一部を露出させる開 口部を有するカプセル化材料の本体部と、閉口部に近接 したカプセル化材料の本体部に取付けられた導電性部材 又はフレームとを有する指紋検知装置を含む。導電性材 料は、ダイに接着的に固定され、接着剤及び導電性部材 は、カプセル化材料の本体部とダイとの間の中間面に対 する対止として機能し、製造の中間段階の間に、除去可 能な材料の本体部を取り囲むフレームを固成する。 組立 体をカプセル化するためプラスチックが射出成形される と共に、除去可能な材料の本体部とフレームは集積回路 のダイ上に配置される。



#### 【特許確求の範囲】

【請求項1】 集積回路のダイと、

上記集積回路のダイを取り囲み、上記集積回路のダイの 一部分を露出させる開口部を中に有するカプセル化材料 の本体部と、

上記閉口部に近接した上記カプセル化材料の本体部に取 付けられたフレーム部材とからなる集積回路装置。

【請求項2】 上記カブセル化材料の本体部内の上記開 口部を介して露出した上記集積回路のダイの一部分は、 指紋センサにより構成されたセンサ部よりなる請求項 1 10 各金属層は、比較的薄く、かつ、上記集積回路のダイに 記載の集積回路装置。

【請求項3】 上記フレーム部材は、上記カプセル化材 料の本体部内の上記頭口部の少なくとも一部分を面成す るよう配置され、

好ましくは、上記フレーム部材は、閉じた幾何学的な形 状を有し、かつ、導電性があり、

上記フレーム部材を上記集積回路のダイに電気接続する 相互接続手段を備え、

上記フレーム部材に動作的に接続され、上記フレーム部 材の電圧をクランプする電圧クランプ手段を更に有する 20 【請求項9】 集積回路のダイを設ける段階と、 請求項1又は2記載の集積回路裝置。

【饋求項4】 上記集積回路のダイは、

複数の接合パッドと、

上記複数の接合パッドを腐食から保護する接合パッド封 止手段と、

比較的剛性のある基板と、

上記基板上にあり、比較的薄く、上記集積回路のダイに 強度を与えるため比較的剛性がある複数の金属層と、

上記集積回路のダイと上記フレーム部材との間の粘着層

上記フレーム部材と上記カプセル化材料の本体部との間 に機械的なロックを形成するため上記フレーム部材と上 記カプセル化材料の本体部との間の中間面に固成された 固定手段とを更に有する請求項1万至3のうちいずれか 1 項記載の集積回路装置。

【請求項5】 上記各接合パッドは、庭食しやすい金属 の第1の層により構成され、

上記集積回路のダイを取り囲み、上記集積回路のダイの 一部分を露出させ、上記複数の接合パッドを覆う開口部 を中に有するカプセル化材料の本体部と、

上記複数の接合パッドを腐食から保護する接合パッド封 止手段とを更に有し、

上記カプセル化材料の本体部の上配開口部を介して露出 した上記集積回路のダイの一部分は、指紋センサにより 構成されたセンサ部からなる請求項1万至3のうちいず れか1項配載の集積回路装置。

【請求項6】 上記接合パッド封止手段は、上記第1の 層の上の障壁金属層からなり、

好ましくは、上記障壁金属層は難溶性金属からなり、 上記接合パッド對止手段には、上記第1の層の縁部を覆 50 料の本体部を形成する段階と、

い、好ましくは窒化珪素である保護膜層が含まれる請求 項5記載の集積回路装置。

【請求項7】 上記接合パッド對止手段は、上記障量金 属層の上に金の層を更に有し、

上記電圧クランプ手段は、ユーザが上配導電性部材に触 れたとき動作的にユーザの静電電荷を減少させる請求項 1乃至6のうちいずれか1項記載の集積回路装置。

【請求項8】 上記集積回路のダイは、比較的開性のあ る基板と、上記基板上の複数の金属層とからなり、

強度を与えるため比較的期性があり、上記集積回路のダ イの一部分を露出させる開口部を中に存し、

上記カプセル化材料の本体部の上記開口部を介して貸出 した上記集積回路のダイの上記一部分はセンサ部により 極度され.

上記各金属層は、タングステン、モリブデン、及びチタ ンの中の少なくとも一つから選択された難溶性金属によ り構成され、上記各金属層はアルミニウムを全く含まな い請求項7記載の集積回路装置。

上記集積回路のダイの上に除去可能な材料の本体部を配 僧する段階と、

上記集積回路のダイ及び上記除去可能な材料の本体部の 周辺にカプセル化材料の本体部を形成する段階と、

上記集積回路のダイの一部分が露出されるよう、上記カ プセル化材料の本体部を通る際口部を回成するため上記 除去可能な材料の本体部を除去する段階とからなる集積 回路装置を製造する方法。

【請求項10】 上記集積回路のダイを設ける段階は、 30 上記カプセル化材料の本体部の上記閉口部を介して露出 されるべきセンサ部よりなる集積回路のダイを設ける段

上記センサ部は上記カブセル化材料の本体部の上記開口 部を介して露出されるべき指紋センサ部である請求項9

【頭求項11】 フレーム部材を上記除去可能な材料の 本体部に固定する段階を更に有し、

上記除去可能な部材の本体部を除去する段階は、上記フ レーム部材が上記カプセル化材料の本体部と適当な場所 40 に維持される間に上配除去可能な部材の本体部を除去す る段階を有し、

上記除去可能な材料の本体部を配置する段階は、上配集 積回路のダイに接着的に上記フレーム部材を固定する段

上記フレーム部材を固定する段階は、上記除去可能な材 料の周辺の周りに上記フレームを完全に固定する段階を 右1...

上記除去可能な材料の本体部及び上記集積回路のダイの 周辺に射出成形プラスチックからなる上記カプセル化材

液体に可溶性の材料の本体部を設ける段階と、 上記液体に可溶性の材料の本体部を液体に晒すことによ り除去する段階とを更に有する請求項9又は10記載の

【鯖水頂12】 上記除去可能な材料の本体部に導電性 部材を固定する段階と、

上記集積回路のダイ上に上記除去可能な材料の本体部及 び上記導電性部材を配置する段階と、

上記集積回路のダイと、上記除去可能な材料の本体部及 び上記導電性部材との周りに上記カプセル化材料の本体 10 【発明の詳細な説明】 部を形成する段階と、

上記導電性部材が上記カプセル化材料の本体部に関し適 当な場所を保つと共に、上記集積回路のダイの一部分が 露出するよう、上記カプセル化材料の本体部を通る閉口 部を国成するため、上記除去可能な材料の本体部を除去 する段階と、

上記カプセル化材料の本体部の上記開口部を介して露出 されるべき上記指紋センサにより構成された上記センサ 部よりなる上記集積回路のダイを設ける段階とを更に有 【請求項13】 ユーザの指による接触のための指紋検 知部からなる集積回路のダイと、

上記集積回路のダイを取り囲み、上記集積回路のダイの 上記指紋検知部を採出させる関口部を中に有するカプセ ル化材料の本体部と、

上記開口部に近接した上記カプセル化材料の本体部に取 付けられた導電性部材とからなり、

上記導電性部材は、上記カプセル化材料の本体部内の上 記聞口部に対するフレームの少なくとも一部分を固成す るよう配置され、

上記導電性部材は、閉じた幾何学的形状、好ましくは矩 形の形状を有し、

上記導電性部材を上記集積回路のダイに電気接続する相 互接統手段を更に有する指紋検知装置。

【請求項14】 上記相互接続手段は、

上記導電性部材と上記集積回路のダイとの間の導電性接

上記集積回路のダイ内の少なくとも1個のピアと、 上記少なくとも1個のピア内の導電性材料とからなる請 求項13記載の指紋検知装置。

【請求項15】 上配指紋検知部は電界指紋センサから ten.

上記電界指紋センサは、

電界感知電極の配列と、

上記電界感知電極に近接し、近接した指を受容する誘電 体層と、

上記電界感知電極が指紋画像信号を生成するように、上 記電界感知電極及び近接した上記指の部分に電界駆動館 号を印加する駅動手段と、

上記導電性部材に動作的に接続され、上記導電性部材の 50 検知及びマッチングの大きな進步が望まれる。本発明の

電圧をクランプする電圧クランプ手段と、

ユーザの指が上記導電性部材に触れたときユーザの静電 電荷を減少させる静能放電手段とを含む請求項13又は 14配戦の指紋検知装置。

【請求項16】 上記集積回路のダイに接続されたリー ドフレームを含み、

数も外側の保護膜層は、壁化物、炭化物、及びダイヤモ ンドの中の少なくとも一つにより構成される請求項15 記載の指紋検知装置。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の分野に係 り、特に、集積回路装置及びそのパッケージに関する。 [0002]

【従来の技術】幾つかの応用は、ヒト又はヒトの部位と の直接的な接触のためアクセスできるように、集積回路 のダイの最も外側表面が周囲に晒されることを必要とす る。例えば、ある種の医学的な応用は、血液の化学的性 質を測定するため刺き出しの集積回路を血流内に置く。 する請求項9万至11のうちいずれか1項配載の方法。 20 幸運にも、かかる応用において、回路の動作寿命は限定 され、回路は廃棄される前に1回しか使用されない。従 って、長期間の信頼性は、典型的に重要な問題ではな W.

> 【0003】一方、感知素子の集積回路配列に基づく指 紋センサは、指による集積回路のダイとの直接的な接触 を必要とする。指紋検知及びマッチングは、個人識別又 は衝合のための高信頼性、かつ、広く使用される技術で ある。典型的な電子指紋センサは、可視光、赤外光、又 は超音波放射を用いて指の表面を照明することに基づ 30 く。反射されたエネルギーは、例えば、ある種のカメラ で捕捉され、得られた画像は、フレーム化、ディジタル 化され、静止ディジタル画像として記憶される。例え ば、米国特許第4, 210, 899号明細書には、人が ある場所に入るのを許可し、或いは、コンピュータ増末 へのアクセスを与えるような安全なアクセスの応用のた め中央処理ステーションと協働する光学走査式指紋読み 取り器が開示されている。米国特許第4,525,85 9号明細書には、指紋画像を捕捉するビデオカメラが開 示され、基準指紋のデータペースとのマッチを判定する 40 ため、指紋の詳細、即ち、指紋の隆起の枝及び末端部が 使用される。

【0004】米国特許第4,353,056号明細書 は、生の指紋を検知する別の方法を開示する。米国特許 第5、325,442号明細書は、複数の感知電極を含 む指紋センサを開示する。

【発明が解決しようとする課題】 コンピュータワークス テーション、器具、車両、及び信用データの許可されて いない使用を可能にさせるため、識別及び照合用の指紋 目的は、集積回路のダイに対する信頼性の高い環境の封 止を行うため、ユーザの指のような検知される媒体によ り集積回路のダイの直接的な接触を可能にさせる集積回 路装置及び関連した方法を提供することである。

【0006】本発明の他の目的は、大規模かつ比較的低 コストの製造を容易に行う集積回路装置及び関連した方 法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、集積回路のダ イと、上記集積回路のダイを取り囲み、上記集積回路の 10 ダイの一部を露出させる閉口部を中に有するカプセル化 材料の本体部と、中の閉口部に近接した材料をカプセル 化する上記本体部に取付けられたフレーム部材とからな る集積回路装置を含む。

【0008】本発明は、集積回路のダイを設ける段階 と、除去可能な材料の本体部を上記集積回路のダイの上 に配置する段階と、上記集積回路のダイの周辺にカプセ ル化材料の本体部及び上記除去可能な材料の本体部を形 成する段階と、上記集積回路のダイの一部を露出させる するよう上記除去可能な材料の本体部を除去する段階と からなる集積回路装置を製造する方法を含む。

【0009】導電性部材を集積回路のダイに粘着的に固 定する方が有利である。従って、導電性部材及び接着剤 は、カプセル化材料とダイとの間の中間面を對止するた め役立つ。導電性部材は、製造の中間段階の間に、除去 可能な材料の本体部を取り囲むフレームを固成する。よ り詳細に言うと、除去可能な材料の本体部及びそのフレ ームは、集積回路のダイ上に置かれ、一方、プラスチッ 除去可能な材料の本体部は、次に、除去され、これによ り、カプセル化材料の本体部に関口部を形成し、周囲の カプセル化材料の本体部に固定された漢電性フレームは そのままの状態で残す。この実施例において、導電性部 材は、製造中にフレームを固成し、集積回路のダイの近 接した部分を賃出させるため開口部の形成を容易にす る。上記導電性部材は、集積回路装置の回路の一部でも IV.

【0010】集積回路装置は、好ましくは、導電性部材 を集積回路のダイに電気的に接続する相互接続手段を含 40 により触られるので、金属層は、集積回路のダイに付加 む。例えば、相互接続手段は、導電性部材と集積回路の ダイとの間にある導電性の接着剤と、集積回路のダイ内 の少なくも1個の導体が充填されたピアとを含む。本発 明の指紋検知の実施例に対し、集積回路のダイは電界指 紋センサにより構成するのが好適である。より詳細に甘 うと、電界指紋センサは、好ましくは、電界感知電極の 配列と、上記電界感知電極に近接した誘電体層と、上記 電界感知電極が指紋画像信号を生成するよう上記電界感 知電極及び近接した指の部分に電界駆動信号を印加する 駆動手段とを含む。従って、導電性材料は、指紋検知部 50 集積回路のダイ上に配置する段階と、上配集積回路のダ

の気板としての機能を行う。

【0011】本発明の他の面は、指紋を検知するためユ ーザが集積回路袋置に触れる点に基づく。導電性部材は ユーザの指により接触されるので、電圧クランプ手段 は、好ましくは、静電気の蓄積を除去すべく薄電性部材 の電圧をクランプするため導電性部材に動作的に接続さ れ、これにより、集積回路装置を静電放電の損傷から保 護し、又は、集積回路袋置に触れたときユーザを電気シ ロックから保護する。

【0012】特に、集積回路のダイは、好ましくは、複 数の接合パッドを更に有する。従って、カプセル化材料 の本体部は、好ましくは、複数の接合パッドを覆う。更 に、複数の接合パッドを腐食から保護するため接合パッ ド對止手段が設けられる。各接合パッドは、アルミニウ ム製のような第1の金属層からなる。従って、接合パッ ド對止手段は、第1の金属層の上に障壁金属層を有す る。接合パッド對止手段は、障強金属層の上に金の層を 更に有する。接合パッド對止手段は、フレームを与え、 ダイとの中間面を封止する導電性材料と共に使用される ため、上記カブセル化材料の本体部を通る閉口部を画成 20 場合がある。或いは、ある実施例の場合に、接合パッド 封止手段は、導電性部材又はフレーム部材を伴うことな (使用される。

【0013】カプセル化材料の本体部は、好ましくは、 射出成形プラスチックにより構成するのが適当である。 固定手段は、好ましくは、フレーム部材の導電性部材と カプセル化材料との間に機械的ロックを形成するため、 フレーム部材の導電性部材とカプセル化材料との間の中 間面に国成される。腐食検知手段は、集積回路の可能な 耐用期間の終わりを通知する等により信頼性を保証する クはその組立体をカプセル化するため射出成形される。 30 ための更なる支援を与えるべく集積回路のダイに関連さ せられる。集積回路装置は、集積回路のダイに接続され たリードフレームを更に有する。その上、導気性部材 は、例えば、金のような金属により構成される。集積回 路のダイは、好ましくは、例えば、盘化物、炭化物、又 はダイヤモンドの中の少なくとも一つからなる頑丈な最 も外側の保護胰層により構成される。

> 【0014】本発明の他の面によれば、集積回路のダイ は、シリコン基板のような比較的剛性のある基板と、基 板上の複数の金属層とからなる。ダイは典型的にユーザ 的な強度を与えるため、好ましくは、比較的薄く、か つ、比較的剛性がある。好ましくは、各金属層は、タン グステン、モリブデン、チタンのような難溶性金属から なる。本発明の上記面に従って別の観点から検討する に、各金属層は、比較的柔らかいアルミニウムを全く含 まない方が好ましい。

> 【0015】本発明によれば、集積回路装置を製造する 方法が提供される。上配方法は、好ましくは、集積回路 のダイを設ける段階と、除去可能な材料の本体部を上記

イ及び上記除去可能な材料の本体部の周辺にカプセル化 材料の本体部を形成する段階と、上記集積回路のダイの 一部を露出させるべく、上記カプセル化材料の本体部を 通る開口部を画成するため、上記除去可能な材料の本体 部を除去する段階とからなる。集積回路のダイは、指紋 センサのようなセンサでもよく、又は、他の集積回路装 置でもよい。

7

【0016】上記方法は、フレーム部材を上記除去可能 な材料の本体部に固定する段階を更に有する。上記フレ ーム部材は、導電性材料からなる。更に、上記除去可能 10 は、おそらく図4及び図5に最も良く示されているよう な材料の本体部を除去する段階は、好ましくは、上記フ レーム部材を上記カプセル化材料の本体部と共に適切な 場所に残したまま、上記除去可能な材料の本体部を除去 する段階を含む。上記除去可能な材料の本体部を配置す る段階は、好ましくは、上記フレーム部材を上記集積回 路のダイに接着的に固定する段階を含む。上記カプセル 化材料の本体部を形成する段階は、上記除去可能な材料 の本体部及び上記集積回路のダイの周辺でプラスチック を射出成形する段階を含む。更に、除去可能な材料の本 体部は、可溶性材料の本体部でもよく、上記除去可能な 20 りも信頼性が高い。 材料の本体部を除去する段階は、好ましくは、上記材料 の本体部を液体溶媒に晒す段階を含む。

【0017】集積回路装置を製造する本発明の他の方法 は、集積回路のダイを設ける段階と、外側に延在する突 出部が上記集積回路のダイの一部と接触するように、本 体部と上記外側に延在する突出部とを有する型を上記集 **積回路のダイの上に配置する段階と、カプセル化材料を** 上記型の内部に配置し、上記集積回路のダイを取り囲む 段階とからなる。上配方法は、好ましくは、上記カプセ 上記集積回路のダイの一部を露出させるため、上記突出 部を含む上記型を除去する段階を更に有する。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明 の実施例を説明する。図1乃至図3を参照して、最初に 指数センサ30を説明する。図示されたセンサ30は、 筐体又はパッケージ51と、指の配置表面を提供するパ ッケージの上部表面に移出した誘電体帯52と、複数の 信号伝導体又はリード線53とを含む。誘電体層52の 組に説明するように指の接触電極を提供する。センサ3 0は、パッケージに組み込まれた処理のレベルに依存し た精巧なレベルの範囲の出力信号を供給する。

【0019】指紋センサ30は、キーボード36と付随 した折りたたみ式表示スクリーン37とを含むノートプ ックコンピュータ35 (図1) のようなコンピュータワ ークステーションにアクセスを許可するため使用され る。換骨すれば、ノートブックコンピュータの情報及び プログラムに対するユーザのアクセスは、所望又は予め

【0020】センサ30は、コンピュータ債報システム 40の一定のワークステーション41に対するアクセス を許可又は拒絶するため使用される。システムは、ロー カルエリアネットワーク (LAN) 42により接続され た複数のワークステーション41を含み、ローカルエリ アネットワーク42は、指紋做別サーバ43と、総合的 な中央コンピュータ44とに接続される。

【0021】図4乃至図10を参照するに、センサ30 に、配列パターンに配置された複数の個別の画素又は感 知素子30 aを含む。当業者により容易に理解されるよ うに、感知素子は非常に小さいので、典型的な指紋の尾 根59及びその間にある谷60(図4)を検知し得る。 更に当業者により認められるように、本発明により電界 センサ30から得られるような生の指紋の読み取り値 は、尾根及び谷のパターン状の指の皮膚の伝導を、例え ば、基板上の指紋面像、或いは、指の3次元モデルでさ え模擬することが非常に困難であるため、光学式検知よ

【0022】センサ30は、基板65と、基板上の1層 以上の活性半導体層66とを含む。例示された実施例に おいて、接地面電極層68は、活性層66の上にあり、 絶縁層67により活性層から隔離される。駆動電極層7 1は、他の誘電体層70の上にあり、励起駆動増幅器7 4に接続される。励起駆動信号は、典型的に、約1 k H z乃至1MHzの範囲内に収まり、配列の全体に亘って コヒーレントに伝達される。従って、駆動又は励起電極 は、かくして、比較的に単純化され、かつ、センサ30 ル化材料の本体部を通る関口部を画成し、これにより、 30 の全体のコストは低下させられ、一方、信頼性は向上す

【0023】別の絶縁層76は駆動電極層71の上にあ り、例えば、円形状の感知電極78は絶縁層76の上に ある。概略的に図解され、当業者により容易に認められ るように、感知電極78は、活性層66に形成された感 知電子部品73に接続してもよい。環状のシールド電極 80は、隙間のある関係で感知電極78を取り囲む。当 業者により容易に認められるように、感知電極78及び その周囲のシールド電極80は、例えば、面素又は感知 周辺を取り囲む伝導性の小片又は電極54は、以下に詳 40 素子30aの接近して詰め込まれた配置又は配列を容易 に実現するため、例えば、六辺形のような他の形状でも よい。シールド電極80は、電界エネルギーの集中を助 け、更に、これにより、近接した電極の駆動の必要性を 低減させるため、増幅器回路73の出力の一部により駆 動された活性シールドである。従って、各感知素子が個 別に駆動されることが要求された従来技術のセンサとは 明らかに対照的に、センサ30は全ての感知素子がコヒ ーレント駆動信号により駆動されることを可能にさせ 3.

登録された指紋が最初に検知されたときに限り許可され 50 【0024】更に図8乃至図10を参照するに、励起電

極71は、間隔d1の感知電極78との間に第1の電界 を発生させ、関係は2の感知電極78と指の表面79と の間に第2の電界を発生させる。即ち、第1のキャパシ タ83 (図9) は励起電極71と感知電極78との間に 園成され、第2のキャパシタ85は指の皮膚79と接地 との間に固成される。第2のキャパシタ85の容量は、 感知電極78が指紋の尾根又は谷のどちらに近接するか に依存して変化する。従って、センサ30は容量性分圧 器としてモデル化できる。単位利得の電圧フォロワ又は 増幅器73により検知された電圧は、関隔d2が変化す 10 ると共に変化する。

【0025】一般的に貸うと、感知素子30aは、非常 に低電流及び非常に高インピーダンスで動作する。例え ば、各感知電極78からの出力信号は、ノイズの影響を 軽減し、かつ、更なる信号の処理を行うため、約5乃至 10ミリポルトが望ましい。シールド電極80の外径に より画成されるような各感知素子30 aの近似的な直径 は、約0.002乃至0.005インチである。励起誘 電体層76及び表面誘電体層54は、約1μmの範囲の 厚さを有することが望ましい。接地面電極68は、励起 20 ージングは比較的低価格でなければならない。 電極71から活性電子装置をシールドする。比較的厚い 誘電体層 6 7 は、上記二つの構造の間の容量を低下さ せ、これにより、励起電極を駆動するため必要とされる 電流を低下させる。電極78、80用の伝導体を通して 括性電子回路に伝えられる種々の信号は、当業者により 理解されるように容易に形成される。

【0026】センサ30の接触又は感知表面の全体は、 **税機の寸法が約0.5インチずつであることが望まし** く、この寸法は製造が容易であり、かつ、正確な指紋検 知及び照合のため十分に大きい表面が得られる。本発明 30 によるセンサ30は、作動しない画素又は感知素子30 aをかなり許容する。典型的なセンサ30は、縦横が約 256個ずつの画素又は感知素子の配列を含むが、本発 明によれば、他の配列の寸法も考慮されている。センサ 30は、製造コストを著しく低下させるため、主とし て、従来の半導体製造技術を用いて同時に製造される。 【0027】更に図11を参照して、指紋センサ30の パッケージングを説明する。当業者により容易に理解さ れるように、集積回路指紋センサは、走査又は検知され ージングの困難さが生じる。典型的に、従来の集積回路 の製造において集積回路の接触は、汚れの可能性が機分 あるので、回避することが望ましい。問題の主要な汚れ は、ナトリウム及び他のアルカリ金属である。上配のイ オン性の汚れは、典型的に集積回路を保護膜処理するた め使用されるSiO2 層内で非常に高い移動性を有す る。結果として生じた酸化電荷は、特に、MOS技術の デバイス特性を劣化させる。

【0028】移動性イオンの汚れを創御する従来の一つ の方法は、集積回路上の操がドープされた保護膜層と共 50 を認める。

に封止パッケージングを使用することである。旗のドー ブ処理は、当業者により容易に理解されるように、トラ ップ機構により汚れの移動性を低下させる。プラスチッ クパッケージングは、より広まり始め、窒化珪素又は炭 化珪素の保護膜層はブラスチックパッケージングと共に 使用される。窒化珪素又は炭化珪素は、ユーザの指と集 積回路との間の直接的な接触を許容するため、汚れの浸 遊性を著しく低下させる。従って、窒化珪素又は炭化珪 素は、好ましくは、本発明に従って指紋センサ30の保 護層として使用される。

10

【0029】指紋センサ30のような集積回路装置は、 幾つかの固有のパッケージング要求を生じさせる。即 ち、パッケージは、指とセンサのダイとの接触を可能に させるため関く必要があり、パッケージは、乱暴な使用 に耐えるため物理的に強くなければならず、パッケージ とダイは、洗い落としを含む洗浄剤及び/又は消毒液に よる繰り返しの清掃に耐え得る必要があり、ダイは、広 範囲の有機及び無機汚染物との接触に耐え得る必要があ り、かつ、磨耗に耐え得る必要があり、最終的にパッケ

【0030】パッケージ51は、上記のパッケージング の問題を扱う。パッケージ51は、パッケージのカプセ ル化材料の本体部94を形成するため射出成形中にリー ドフレーム93に取付けられた集積回路のダイ91を含 む。接続は、外側に延在するリード線53への接合ワイ ヤ97及びリードフレーム93により形成される。パッ ケージ51の上質表面は、ダイ91への接触を可能にさ せる一体的に成形された関口部98を含む。より詳細に 貸うと、例示された実施例において、関口部98は、電 極54としての機能を行うフレーム部材又は導電性部材 により面成される。電極54は、例えば、以下により辞 しく説明するように、センサ30の製造の際に利点が得 られる導電性接着剤95によりダイ91の下側にある都 分と接続される。

【0031】電極54の内側の露出した側面は僅かに角 皮が付けられる。フレーム部材又は電極54は、プラス チック材料の針と、対応した電観内の溝との間の連結す る嵌め合いにより周囲のカプセル化部材の本体94内の 適当な場所に機械的に保持される。勿論、当業者は、本 る指によって接触される必要があるので、特別なパッケ 40 体部94と電極54との間の中間面に他の遠緒手段の配 置を認める。

> 【0032】電極54は、集積回路のダイ91内の回路 に相互接続された方が有利である。特に、図12を更に 参照するに、導体充填ピア104は、電極54′を接続 するため使用される。図12に示されているように、他 の機械的固定配置を、カプセル化材料の本体部94'と 電便54°との間の中間面に設けてもよい。例示された 電極54'はL字形の断面を有し、当業者は、他の断面 形状が可能であり、かつ、本発明により考慮されること

【0033】更に、図12には、電極94'が開口部9 8'から引き込められた形で設けられた本発明の一実施 例が示される。より詳細に貫うと、以下に詳細に説明さ れるように、支柱105は、成形中に開口部を形成する ため、除去可能な材料の本体部を維持すべく使用され る。換官すれば、1本以上の支柱が、フレーム部材又は 電極54'と成形中に除去可能な材料との間に隙間を画 成する。従って、プラスチックの内面部94aは、射出 成形中に電極54'の内傷に形成される。

11

関係する。より詳しく言うと、当業者により容易に理解 されるように、ユーザの指の上の静電電圧は、適切に放 飲されなければ、集積回路のダイ91'の部品を損傷す る。更に、駆動回路109から電極54′に加えられた 電圧は、ユーザに不慮の衝撃を与えないように所定のレ ベルを超えないことが望ましい。従って、本発明は、ツ エナーダイオード111と抵抗112の対により設けら れた例示された電圧クランプ回路108を含む方が有利 である。指紋センサ又は他の集積回路装置のある種の実 シタとして設能するので、接地電極は必要ではない。し かし、例示された電極54′は、クランプ回路109と 協働して静電放電を放散させるため、指と接触する媒体 を与える方が有利である。本発明の他の実施例によれ ば、電極54は最終的な集積回路装置において必要では

【0035】図13を参照して、本発明の他の面を説明 する。付加的な接合パッド保護が本発明の実施例におい て与えられる。何示された構造の場合、何えば、アルミ 成される。第1の保護膜層122は、上側のダイの表面 全体に形成され、接合パッド120の緑部を覆う。好ま しくはより薄い第2の保護膜層123は、第1の保護膜 層122の上に塗布される。障礙金属層124は、第2 の層123内の関口部に形成され、下にあるアルミニウ ム接合パッド120と接触する。障壁金属は、下にある 比較的腐食しやすいアルミニウムを保護するため、チタ ン/タングステンの層、チタン/タングステン盤化物、 及びチタン/タングステンよりなる合金である。金の層 より容易に認められように、その金の層に接合ワイヤ9 7" が接続される。当業者は、疑いのある接合パッド1 20が水又は他の汚染に晒されたとき、腐食又は崩壊か ら保護する他の類似した構造を認めるであろう。

【0036】外側の保護膜層123は、上記の理由のた め、竄化珪素により構成される。更に、別の保護膜は、 耐磨減性及び物理的保護に利点が得られるポリイミド又 はPTFE (テフロン (登録商標) ) のような有機材料 からなる。炭化珪素又はアモルファスダイヤモンドのよ 子に対する耐磨耗性を非常に強化する。更に、外側の保 護膜層123の材料は、例えば、接合パッドのエッチン グを行うため、標準的な集積回路パターン固成方法と互 換性のあることが好ましい。

12

【0037】図12を参照するに、集積回路のダイ9 1"は、複数の金属層131と、かなり剛性のあるシリ コン基板上に支持された介在する誘電体層130とを含 む。従来の焼き鈍しされたアルミニウムは、典型的に、 比較的柔らかく、比較的大きな厚さで堆積させられる。 - 【0 0 3 4 】図 1 2 は、電極 5 4 'の電圧のクランプに 10 金属層 1 3 1 は、かなり薄く、かつ、かなり剛性のある 難溶性の金属又はその合金により与えられる。例えば、 難消性金属には、タングステン、モリブデン、チタン又 はそれらの合金が含まれる。他の難溶性金属又は非難溶 性の金属は、比較的剛性があり、かつ、比較的障い層の 形に形成されるならば、使用してもよい。例えば、CV Dタングステンに対し、厚さは、好ましくは、約0.1  $\mu$ mよりも厚く、かつ、好ましくは、約1.  $0 \mu$ mより も薄い。他の方法を考慮するならば、金属層は、アルミ ニウムを全く含まない方が好ましい。かくして、集積回 施例において、身体が指紋センサに対する大きいキャパ 20 路のダイ91。は、例えば、ユーザの指による直接の物 理的な接触により生じるような損傷に対しより強い抵抗

【0038】ここで説明する図13に記載された接合パ ッド封止手段は、接着的に固定された電極54により設 けられた中間面の封止と組み合わせて使用した方が有利 であることを当業者は容易に認めるであろう。接合パッ ド對止手段は、図14に示されているように、ある種の 実施例では単独で使用され、中間面、或いは、その一部 分だけの範囲に対し関口部98"に近接したままの状態 ニウム製の接合パッド120は、ダイの外側表面上に形 30 の電極はない。更に図14に示されるように、腐食検知 手段135は、接合パッド、又は、カプセル化された装 置の他の部分の失敗の前に、腐食を検知するため、集積 回路のダイ91"上、又は、そこから離れた制御論理回 路を使用可能状態にするため設けられる。腐食検知手段 135は、当業者により容易に理解されるように、値の 変化が周期的に監視される抵抗回路網により設けられ

【0039】図15には、指紋センサ30""の他の実 施例が示され、同図において、集積回路のダイは、ユー 材料内にカプセル化される。例示されたセンサ30"" は、一般的に矩形状の関口部の一部に沿って延在する単 一の電框54""だけを含む。上記の他の実施例におい て、電極又はフレーム部材は、矩形のような閉じた幾何 学形状を圓成する。カード139は、例えば、データを 収容する磁気の縞138を含み、当業者により容易に理 解されるように指紋センサ30""と共に動作する。カ ード139は、データ処理及び記憶が行えるように1個 以上の集積回路のダイを有する。

うな無機隔は、外側署123に使用され、特に、研磨粒 50 【0040】図16乃至図18を参照して、本発明の方

法の面を説明する。図16に示されているように、電極 54と、除去可能な材料の本体部151と、電極の下側 にある粘着層95とを含む組立体150は、集積回路の ダイ91の上に整列、配置され、集積回路のダイ91 は、リードフレーム93に固定、接続されている。かく して形成された構造体は、従来の集積回路パッケージ射 出成形型160(図17)内に配置され、カプセル化プ ラスチック材料の本体部94が形成される。図18に示 されるように、上記構造体は、例えば、水のような液体 溶媒166を含む槽165内に配置されるので、除去可 10 除去可能な材料の本体部を取り囲むフレームを固成す 能な材料の本体部は、関口部98を集積回路のダイ91 の下にある部分に残して溶解される。更に、除去可能な 材料を分解するため溶媒スプレーが使用される。

13

【0041】図19及び図20を参照して、集積回路装 置30'"(図14)を製造する本発明による他の方法 を説明する。上記実施例において、上側の型部171 は、本体部173と、そこから下方に延在する突起部1 72とを含む。上側の型部171は、下側の型部174 と共に合わされ、プラスチック製のカプセル化材料9 4' "が図20に示されたかくして面成された型の空洞 20 る。 内に射出される。突起部172は、均質ではなく、むし ろ中空である。他の素子は、3重のプライム記号が付け られている。

【0042】当業者により容易に理解されるように、射 出成形中に集積回路のダイタ1に対する突起部172の パイアスを確保するための装備が設けられる。上側及び 下側の型部は、集積回路装置30°″を解放するため分 けられる。本発明は、特に、ユーザの指との直接的な接 触が行われる指紋センサ30に適当である。本発明は、 更に、集積回路のダイを検知される媒体に直接的に貸出 30 させることが望ましく、かつ、ダイの他の部分はかかる 露出から保護されることが望ましい気体又は液体センサ のような他のセンサにも適用される。

【0043】指紋センサ30の種々の実施例と、その関 連した処理回路は、多数の従来の指紋マッチングアルゴ リズムの何れかを使用する。指紋の詳細部、即ち、枝又 は分岐、及び、指紋の尾根の諸点は、サンブル指紋と基 準指紋データベースとの間の適合を判定するため屡々使 用される。かかる詳細部のマッチングは、処理回路によ り容易に実現される。例えば、米国特許第3,859, 633号及び第3,893,080号明細書は、指紋の 詳細部のマッチングに基づく指紋量別に向けられてい る。米国特許第4, 151, 512号明細書は、抽出さ れた尾根の輪郭データを使用する指紋分類方法を開示す る。米国特許第4, 185, 270号明細書は、詳細部 に基づく符号化及び照合の処理を開示する。米国特許第 5,040,224号明細書は、後の詳細部パターンに よるマッチングのため、各指紋画像の核の位置を正確に 決めるべく、指紋を前処理する方法を開示する。

【0044】本発明による集積回路装置は、集積回路の 50 【符号の説明】

ダイと、上記集積回路のダイを取り囲み、上記集積回路 のダイの一部を露出させる関口部を有するカブセル化材 料の本体部と、上記開口部に近接した上記カプセル化材 料の本体部に取付けられた導置性部材又はフレームとを 有する指紋検知袋置を含む。上記導電性材料は、上記集 積回路のダイに接着的に固定される。従って、接着剤及 び導電性部材は、上記カプセル化材料の本体部と上記を イとの間の中間面に対する對止としての機能を行う。接 着剤及び導電性部材は、更に、製造の中間段階の間に、 る。上記の租立体をカプセル化するためプラスチックが 射出成形されると共に、上記除去可能な材料の本体部と そのフレームは上記集積回路のダイ上に配置される。 【図面の簡単な説明】

【図1】ノートブックコンピュータと結合された指紋セ ンサの概略構成図である。

【図2】コンピュータワークステーションと結合された 指紋検出器と、関連する情報処理コンピュータ及びロー カルエリアネットワーク (LAN) の概略構成例であ

【図3】集積回路指紋センサの一実施例の略平面図であ

【図4】一部が非常に拡大された集積回路指紋センサ及 び上に重なる指紋パターンの略平面図である。

【図5】上部誘電体層が除去された集積回路指紋センサ の拡大部分平面図である。

【図6】集積回路指紋センサの略部分斜視図である。

【図7】集積指紋センサの略部分断片図である。

【図8】電界を例示する部分断面略側面図である。

【図9】集積指紋センサの一部の概略回路図である。

【図10】電界を例示する更なる部分断面拡大略側面図 である。

【図11】図3のライン11-11による値かに拡大さ れた略断面図である。

【図12】集積回路装置の他の実施例の非常に拡大され た部分断面略図である。

【図13】集積回路装置の一実施例による接触パッド部 の非常に拡大された部分断面略図である。

【図14】集積回路装置の他の実施例の非常に拡大され 40 た部分断面略図である。

【図15】携帯カードに組み込まれた集積回路指紋セン サの平面図である。

【図16】製造中の集積回路装置の略断面図である。

【図17】製造中の集積回路装置の略断面図である。

【図18】製造中の集積回路装置の略断面図である。

【図19】他の製造処理中の集積回路装置の略断面図で

【図20】他の製造処理中の集積回路装置の略断面図で ある。

特開平9-289268 30, 30', 30", 30'", 30"" 93, 93' \* リードフレーム 指紋セ ンサ 94,94',94'" カプセル化材料の本体部 30a 感知素子 94a プラスチックの内面部 306 国像セル 9.5 導電性接着剤 35 ノートブックコンピュータ 97, 97", 97' \*\* 接合ワイヤ 36 キーボード 98 開口部 37 表示スクリーン 104 導体充填ビア 39 スピーカ 105 支柱 40 コンピュータ情報システム 108 電圧クランプ回路 41 ワークステーション 10 109 駆動回路 42 ローカルエリアネットワーク 111 ツェナーダイオード 43 指紋鐵別サーバ 112 抵抗 4.4 中央コンピュータ 120 接合パッド 51 パッケージ 122 第1の保護膜層 52,70 誘電体層 123 第2の保護膜層 53,53'\* リード線 124 障壁金属層 54,54',54"" 電阻 126 金の層 59 指紋の尾根 130 誘電体層 60 指紋の谷 131 金属層 65 基板 20 135 腐食検知手段 66 活性半導体層 138 磁気の縞 67,76 絶縁層 139 カード 68 接地面電極層 150 組立体 71 駆動電極層 151 除去可能な材料の本体部 73 感知電子部品 160 集積回路パッケージ射出成形型 7.4 励起驱動增幅器 165 78 感知電極

> 図1] [图2]

166 液体溶媒

172 突起部

174 下側の型部

30 173 本体部

上側の型部

171



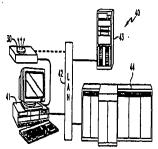
91, 91', 91", 91'" 91

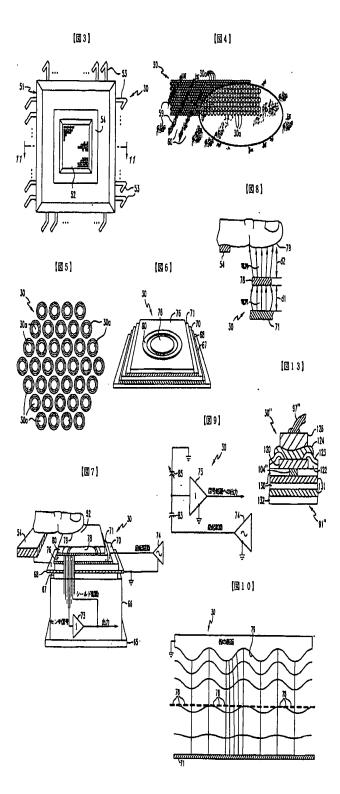
79 指の表面

80 シールド電極

83 第1のキャパシタ

85 第2のキャパシタ





-0-

